



半導体リスキリング研修 ものづくり現場の課題を解決！ 製品開発・不良解析スキルアップ研修

受講料
無料

概要

ものづくり現場で活用されている分析装置を用いた解析技術について学び、実務に直結する知識を習得します。講師には分析装置メーカーのエンジニアを迎え、現場での活用事例を通じて実践的な内容を理解できる内容となっており、技術者のスキルアップに最適な研修です。

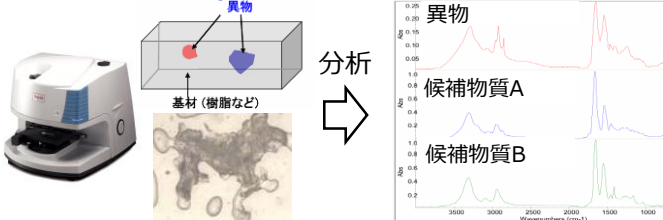
利用用途

■電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)
ナノメートル単位の高分解能観察



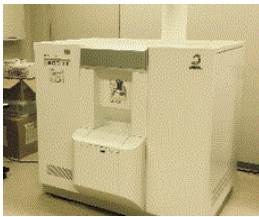
出典:日本電子株式会社。【販売終了】JSM-IT800ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡, <https://www.jeol.co.jp/products/scientific/sem/JSM-IT800.html>, (参照2025/7/28)

■フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR)
異物の解析(ゴム片やプラスチック等)

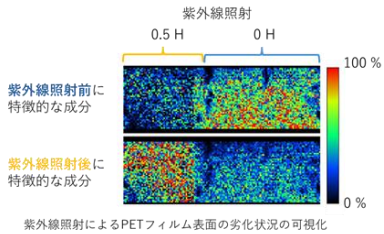


出典:サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社。"赤外線顕微鏡による異物分析の基礎と測定および解析のコツ", <https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Scientific-Resources/Basics-of-foreign-body-analysis-by-infrared-microscope-and-tips-for-measurement-t-and-analysis-ja.pdf>, (参照2025/7/28)

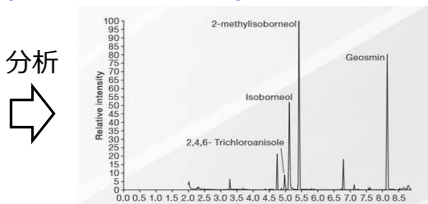
■マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間質量分析計 (MALDI-TOFMS)
高分子材料の解析



出典:日本電子株式会社。"イメージング質量分析法と走査電子顕微鏡を用いたポリエチレンテレフタレートフィルムの紫外線照射による劣化解析", <https://www.jeol.co.jp/solutions/applications/details/HS05.html>, (参照2025/7/28)



■熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)
材料・異物の解析(樹脂や工業油等)



研修日程・定員 全日程にわたり無料でご参加いただけます。

日程			内容	定員
①	9月10日 (水) 講義	9:00 ～12:00	「FE-SEM, MALDI-TOFMSを用いた解析手法」 講師:日本電子株式会社 エンジニア	35名 /日
		13:30 ～16:30	「FT-IR, GC-MSを用いた解析手法」 講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 エンジニア	
②	9月11日 (木) 実機デモ	9:00 ～12:00	「FT-IRによる異物解析 実機デモ講座」 講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 エンジニア ※午前、午後の部は同一内容のため、いずれか一方にご参加ください	5名 /回
		13:30 ～16:30		

※①、②の内、ご希望の回をお申し込みください。
※定員に限りがございます。お申し込み多数の場合は、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

会場

大分県産業科学技術センター 第1研修室 他
(大分市高江西 1-4361-10)



【JRのご利用（JR大分大学前駅からのアクセス）】
JR豊肥本線 大分駅～大分大学前駅 下車
〔所要時間13分〕

大分大学前駅～大分県産業科学技術センター
徒歩：所要時間25分 およそ1.6 km
バス：大学宿舍前乗車～産業科学技術センター下車
〔所要時間 5分〕
※行先系統番号
(F40番台・G40番台・H40番台：大南団地行き)

駐車場

大分県産業科学技術センター敷地内の駐車場をご利用いただけます。

お申込み・お問合せはこちら

申込方法

URLからアクセスの上、お申込みください

<https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/r7-kaiseki>



申込締切

令和7年9月5日（金）

お問い合わせ

大分県産業科学技術センター 工業化学担当 安藤、上野、安部
TEL：097-596-7101、E-mail：i-chem@oita-ri.jp

